Inhaltsverzeichnis/Contents

W.	Schäfer,
K.	Niederauer

Halbleiteruntersu	chungsverfahr	en im	Rasterelektro
nenmikroskop -	EMK/EBIC un	d Poten	tialkontrast

Technique	s for	Studying	Semi	conduc	tors in	the
Scanning	Electro	n Microsco	pe -	EMF/E	BIC and	Vol-
tage Contr	rast					267

iteratur-Notizen /	Literature	Reviews	28

K. Friedrich

A. Tekin, A. Wirth

Versagensverhalten verstärkter thermoplastischer Kunststoffe

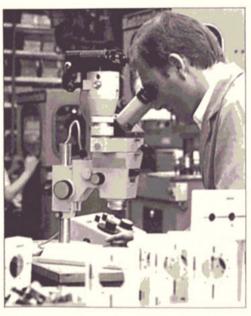
Failure	Behaviour	of	Reinforced	Thermoplastic	Poly-
mers					283

The	Structure	and Mech	hanical Pr	roperties	of	Fe-M
Co	and Fe-Mn	-Co-Mo Al	lloys (Part	2)		

Gefüge	und	mechanische	Eigensch	haften	von	Fe-Mr
Co- und	Fe-I	Mn-Co-Mo-Leg	ierungen	(Teil:	2)	30

Co- und Fe-Mn-Co-Mo-Legierungen (Tell 2)	301
Pinholing in Copper Water-Piping Lochfraß in Wasserleitungsrohren aus Kupfer	311
Labortip/Laboratory Tip	314
Mitteilungen/Information	315
Tagungskalender/Meeting Diary	316

Mehr sehen, besser erkennen, schneller prüfen mit Zeiss Stereomikroskopen – auch an großen Objekten



Materialprüfung, Fertigungs- und Endkontrolle.

Zeiss Stereomikroskope bieten die besten Voraussetzungen zum Erkennen von Strukturen, Oberflächen und Materialfehlern.

Optimale Geräte- und Objektpositionierung an Tisch-, Boden- und Schwenkstativen sowie mit speziellen Objektischen. Dadurch wird hohe Flexibilität bei der Untersuchung auch großer Objekte erreicht.

Arbeitsabstande bis 2000 mm ermöglichen bequemes Beobachten und Photographieren. Im Auflicht und Durchlicht, im Hellfeld, Dunkelfeld, polarisierten Licht und Fluoreszenzlicht.

Fragen Sie uns nach Ihren Möglichkeiten mit Zeiss Stereomikroskopen.

Zeiss setzt Maßstäbe in Optik, Feinmechanik, Elektronik



West Germany

Carl Zeiss Geschäftsbereich Mikroskopie Postfach 1369/1380 D-7082 Oberkochen

info-coupon

Bitte, senden Sie mir weitere Informationen über Zeiss Stereomikroskope

Absender

PMG 685